

國立中山大學貴重暨共用儀器中心儀器計費一覽表

學術服務領域	儀器名稱	項目名稱	英文名稱	單位	計畫預約單價	非計畫預約單價	自行操作計畫計費單價	自行操作非計畫計費單價
年度					114	114	114	114
化學								
1	電子順磁共振光譜儀	DMPO試劑	DMPO	0.001g 單位	200	1,000	0	0
		TEMPO試劑	TEMPO	0.05g單位	100	1,000	100	1,000
		水氧敏感樣品前處理	sample preparation for O2-/moisture-sensitive compound	單一樣品	300	2,000	0	0
		汞燈照射	irradiation with UV lamp	單一樣品15分鐘內每單一波長	300	1,200	300	1,200
		汞燈裝置架設	installation fee for UV lamp equipments	單一預約序號	600	0	600	0
		非水氧敏感樣品前處理	sample preparation for O2-/moisture-stable compound	單一樣品	150	1,000	0	0
		室溫基本量測	measurement at room temperature	單一樣品	200	1,000	0	0
		液氮變溫測量架設	installation fee for liquid-helium equipments	單一預約序號	1,200	0	1,200	0
		液氮變溫測量	variable-temperature measurement (4K - 340 K)	單一樣品當一溫度/120分鐘	800	6,000	800	6,000
		液氮定溫測量	measurement at constant temperature	150分鐘	400	4,000	400	4,000
		液氮變溫測量	variable-temperature measurement (77K - 340 K)	單一樣品每單一溫度/30分鐘	400	2,000	400	2,000
		液氮變溫裝置架設	Installation of liquid nitrogen variable temperature measuring device	1 次	1,000	0	1,000	0
2	基質輔助雷射脫附游離飛行時間質譜儀	ESI低解析一次質譜定性分析	ESI/QQQ/MS	件	300	1,500	0	0
		ESI低解析二次質譜分析(含一次質譜定性分析)	ESI/Q-TOF/MS/MS	訊號峰	350	1,800	0	0
		GC/MS 一次質譜定性分析	GC/MS	件	500	1,000	0	0
		GC/MS 資料庫搜尋	GC/MS database searching	訊號峰	50	100	0	0
		HPLC/ESI/QQQ 一次質譜定性分析	HPLC/ESI/QQQ/MS	件	1,200	3,000	0	0
		HPLC/ESI/QQQ 二次質譜分析(含一次質譜定性分析)	HPLC/ESI/QQQ/MS/MS	訊號峰	50	100	0	0
		LCMS定量分析	HPLC/ESI/QQQ/MS/MS Quantification	件	8,000	10,000	0	0
		LCMS層析條件優化	chromatographic conditions	件	3,000	6,000	0	0
		MALDI 二次質譜分析(含一次質譜定性分析)	MALDI-TOF/MS/MS	件	350	1,800	0	0
		MALDI 影像質譜	MALDI Imaging	件	10,000	50,000	0	0
		MALDI一次質譜定性分析	MALDI-TOF/MS	件	300	1,500	0	0
		TD-ESI 一次質譜定性分析	TD-ESI/MS	件	300	600	0	0
		TD-ESI 二次質譜定性分析(含一次質譜定性分析)	TD-ESI/MS/MS	訊號峰	1,800	1,800	1,800	1,800
		資料檢索	Database search	次	20	20	0	0
3	超高效能傅立葉轉換電場軌道質譜儀	ESI低解析	ESI	件數	200	1,500	0	0
		高解析度 ESI	high resolution mass(ESI)	件數	300	2,000	0	0
		高解析度MS/MS ESI	MS/ MS ESI high resolution mass(ESI)	件數	300	2,000	0	0
		資料分析	data processing	件數	150	500	0	0
4	600MHz 核磁共振儀(JEOL ECZ-600R)	1D夜間實驗	1Dovernight EXP	12小時	600	6,000	600	6,000
		2D夜間實驗	2D overnight EXP	15小時	900	6,000	900	6,000
		每樣品前半小時	the first 0.5hr /per sample	半小時	150	700	150	700
		假日長時實驗	Long time EXP on holiday	48小時	2,000	2,000	2,000	2,000
		超過半小時者，每半小時	after 0.5hr,per 0.5hr	半小時	90	500	90	500
		變溫實驗	VT experiment	改變溫度每單位	200	200	0	0
材料								
1	FEI Tecnai F20 G2 場發射掃描穿透式電子顯	EDS 分析(點·線·面分析)	EDS Analysis (Point · Line scan · Mapping)	小時	100	300	50	0
		NBD/CBD 繞射分析	NBD/CBD Analysis	小時	100	300	50	0
		STEM 分析(HAADF)	STEM Analysis (HAADF)	小時	100	300	50	0
		高解析成像分析	HR Analysis	小時	100	300	50	0

國立中山大學貴重暨共用儀器中心儀器計費一覽表

學術服務領域	儀器名稱	項目名稱	英文名稱	單位	計畫預約單價	非計畫預約單價	自行操作計畫計費單價	自行操作非計畫計費單價
年度					114	114	114	114
	顯微鏡	電子能量損失能譜EELS/GIF分析	EELS/GIF Analysis	小時	200	600	100	0
		儀器使用費·每時段3小時/1小時計費一次	user charge (3 hours per session)	小時	600	2,000	300	0
2	場發射型掃描式電子顯微鏡	能量分散分析儀面分析	Energy Dispersive Spectrometer-Mapping	次	100	200	100	200
		能量分散分析儀線分析	Energy Dispersive Spectrometer-Line scan	次	100	200	100	200
		能量分散分析儀點分析	Energy Dispersive Spectrometer- Point	點	50	100	50	100
		陰極螢光測試儀常溫	Cryogenic Cathodoluminescence system-normal temperature	小時	150	250	150	250
		場發射型掃描式電子顯微鏡	JEOL 6330 TF Field Emission Electron Microscope	小時	300	1,500	200	1,500
		數位影像處理與傳輸	Digital Image Processing	張	10	10	10	10
3	JEOL 3010 TEM穿透式電子顯微鏡	CCD 照相	Number of photon	張	10	10	10	0
		元素分析(點)	EDS(point)	小時	100	100	100	0
		高解析晶格影像觀察	HR use	小時	100	100	100	0
		燈絲使用	Filament use	小時	400	1,500	200	0
4	軟物質分析穿透式電子顯微鏡	形態觀察分析及繞射分析	Morphology and Diffraction Analysis	時段	1,800	6,000	600	0
		能量分散光譜儀(EDS)點分析	EDS	點	100	300	100	300
5	Talos F200X G2 高解析場發射掃描式電子顯微鏡	EDS(點/線/面)分析	EDS (point/line/map) analysis	小時	200	600	100	0
		STEM(BF/DF/HAADF)分析與HRSTEM分析	STEM(BF/DF/HAADF) and HRSTEM	小時	300	900	150	0
		TEM基本時段(影像與繞射圖)	TEM basis period	小時	600	2,500	300	0
		示差像對比(DPC)影像分析	Differential phase contrast (DPC) analysis	小時	300	900	150	0
		高解析成像分析	HRTEM	小時	100	300	50	0
		高解析原子影像EDS(點/線/面)分析	Atomic-resolution EDS (point/line/map) analysis	小時	500	1,500	250	0
6	多功能高解析場發射型掃描式電子顯微鏡	微區繞射與聚束電子繞射	NBD/CBED	小時	100	300	50	0
		多功能高解析掃描式電子顯微鏡	Zeiss G450 Field Emission Electron Microscope	小時	400	2,500	250	2,500
		能量分散分析儀面分析	Energy Dispersive Spectrometer-Mapping	次	100	200	100	200
		能量分散分析儀線分析	Energy Dispersive Spectrometer-Line scan	次	100	200	100	200
		能量分散分析儀點分	Energy Dispersive Spectrometer- Point	點	50	100	50	100
7	高解析電子微探儀	數位影像處理與傳輸	Digital Image Processing	張	10	50	10	50
		定量分析	Quantitative analysis	點	20	100	10	50
		線分析、面分析、定性分析	mapping and line scan	次	80	300	40	150
8	多功能 X 光 繞射儀	燈絲使用時間	basic expense	小時	600	1,200	450	900
		X光反射率	XRR	每件30分鐘,超時累計	150	1,000	150	1,000
		x光掠角繞射	Grazing Incident Diffraction X-ray	每件30分鐘,超時累計	150	1,000	150	1,000
		相鑑定	data search	每件	150	1,000	150	1,000
		相鑑定-複製	data search	每件	150	1,000	150	1,000
		超時計費	Overtime billing	每30分鐘	150	1,000	150	1,000
9	粉末繞射儀	極圖量測分析	pole figure	每件30分鐘,超時累計	150	1,000	150	1,000
		一般繞射分析	powder diffraction	每件30分鐘,超過則累計	130	800	130	800
		一般繞射分析	powder diffraction	每件30分鐘,超過則累計	130	800	0	0
		相鑑定	件	每件	130	800	130	800
		相鑑定	powder diffraction	每件 600元	600	600	600	600
超時計費	Overtime billing	30分鐘	130	800	130	800		
奈米製程								
		重新訓練費	Retraining fee	1次	850	850	0	0

國立中山大學貴重暨共用儀器中心儀器計費一覽表

學術服務領域	儀器名稱	項目名稱	英文名稱	單位	計畫預約單價	非計畫預約單價	自行操作計畫計費單價	自行操作非計畫計費單價
年度					114	114	114	114
1	高密度電漿化學氣相沉積系統	重新認證費	Recertification fee	1次	350	350	0	0
		訓練費	Training fee	1次	1,700	1,700	0	0
		認證費	Certification fee	1次	700	700	0	0
		儀器使用費	measurement	0.25小時	650	750	350	650
2	感應耦合式電漿蝕刻系統	重新訓練費	Retraining fee	1次	850	850	0	0
		重新認證費	Recertification fee	1次	350	350	0	0
		訓練費	Training fee	1次	1,700	1,700	0	0
		認證費	Certification fee	1次	700	700	0	0
		儀器使用費	measurement	0.25小時	650	750	350	650
3	多靶磁控濺鍍系統	重新訓練費	Retraining fee	1次	550	550	0	0
		重新認證費	Recertification fee	1次	300	300	0	0
		訓練費	Training fee	1次	1,100	1,100	0	0
		認證費	Certification fee	1次	600	600	0	0
		儀器使用費	measurement	0.25小時	420	500	250	450
4	雙電子槍蒸鍍機	Mo坩鍋	Mo crucible	1個	2,500	2,500	2,500	2,500
		重新訓練費	Retraining fee	1次	550	550	0	0
		重新認證費	Recertification fee	1次	300	300	0	0
		訓練費	Training fee	1次	1,100	1,100	0	0
		認證費	Certification fee	1次	600	600	0	0
		儀器使用費	measurement	0.25小時	420	500	250	450
5	快速退火系統	Si wafer	Si wafer	1片	600	600	600	600
		重新訓練費	Retraining fee	1次	300	300	0	0
		重新認證費	Recertification fee	1次	300	300	0	0
		訓練費	Training fee	1次	600	600	0	0
		認證費	Certification fee	1次	600	600	0	0
		儀器使用費	measurement	0.25小時	250	300	110	280
6	光學微影系統	Si wafer	Si wafer	1片	600	600	600	600
		重新訓練費	Retraining fee	1次	300	300	0	0
		重新認證費	Recertification fee	1次	300	300	0	0
		訓練費	Training fee	1次	600	600	0	0
		認證費	Certification fee	1次	600	600	0	0
		儀器使用費	measurement	0.25小時	350	550	150	350
7	薄膜特性分析儀	Si wafer	Si wafer	1片	600	600	600	600
		光碟片	CD	1片	10	10	10	10
		重新訓練費	Retraining fee	1次	300	300	0	0
		重新認證費	Recertification fee	1次	300	300	0	0
		訓練費	Training fee	1次	600	600	0	0
		認證費	Certification fee	1次	600	600	0	0
		儀器使用費	measurement	0.25小時	300	450	200	400
物理								
1	高階三束型聚焦離子束顯微鏡	高階三束型聚焦離子束顯微鏡	FIB	1小時	3,000	8,000	3,000	8,000
		高階三束型聚焦離子束顯微鏡(0.25hr)	FIB(0.25hr)	0.25小時	750	2,000	750	2,000
		高階三束型聚焦離子束顯微鏡(廠商)	FIB(Vendor)	1小時	0	8,000	8,000	8,000
		高階三束型聚焦離子束顯微鏡(廠商0.25hr)	FIB(vendor 0.25hr)	0.25小時	0	2,000	2,000	2,000
		鍍白金-複製	Pt coating	1次	300	300	300	300
		鍍碳銅網試片盒-複製	grid box	1盒	200	200	0	0
		鍍碳銅網-複製	copper grid	1片	60	60	60	60
2	常壓雙光源光電子能譜儀	UPS分析	UPS	小時	400	4,000	0	0
		Ar 離子槍(表面清潔)	Ar ion bombardment	小時	100	1,000	0	0
		X射線光電子能譜分析	monochromated xps	小時	350	3,500	0	0

國立中山大學貴重暨共用儀器中心儀器計費一覽表

學術服務領域	儀器名稱	項目名稱	英文名稱	單位	計畫預約單價	非計畫預約單價	自行操作計畫計費單價	自行操作非計畫計費單價
年度					114	114	114	114
		加開電子槍	Charge neutralization	小時	50	500	0	0
3	超導量子干涉磁量儀	儀器使用時間	Measurement time in SQUID	小時	400	1,000	400	1,000
4	高解析度探針顯微鏡	自行量測	Self-measurement	小時	500	0	500	0
		委託量測	Commissioned measurement	小時	900	3,500	0	0